Reference 1

JP6044144 A SEMICONDUCTOR DISK DEVICE MITSUBISHI ELECTRIC CORP

Abstract:

PURPOSE: To automatically exchange the defect of a memory in a semiconductor disk device.

constitution: The memory 4 composed of a semiconductor storage element, an interface control circuit 1 controlling an interface with a host device, a circuit 2 controlling data transfer on the memory by a request from the interface, a microprocessor 3, a data transfer error detection/correction part 5, a non-volatile memory part 6 for storing transfer error information and a semiconductor memory part 7 for exchange are provided. A fault part on the memory is checked when power is supplied. When a fault is recognized, the fault part is automatically allocated to an exchange area. When the fault of the memory is recognized while data is transferred by the request from the interface, the fault part is automatically allocated to the exchange area so as to save data in the fault part after the transfer of data.

COPYRIGHT: (C)1994,JPO&Japio

Inventor(s):

ITO KAZUHIKO

Application No. JP1992197186A Filed 19920723 Published 19940218

Original IPC(1-7): G06F001216 G06F000306 G06F000308

(19)日本国特许广(JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-44144

(43)公開日 平成6年(1994)2月18日

(51)IntCL⁶ G06F 12/16 識別記号 厅内整理番号 3 1 0 P 7629-5B

FΙ

技術表示窗所

3/06

3 0 6 D 7165-5B

3/08

H 7165-5B

溶査請求 未請求 請求項の数2(全 8 頁)

(21)出願番号

特願平4-197188

(22)出願日

平成 4年(1992) 7月23日

(71)出願人 000006013

三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目 2番 3号

(72)発明者 伊藤 一彦

鎌倉市上町屋325番地 三菱電機株式会社

コンピュータ製作所内

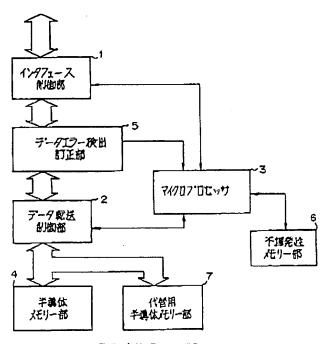
(74)代理人 弁理士 高田 守

(54) 【発明の名称】 半導体ディスク装置

(57)【耍約】

【目的】 半導体ディスク装置のメモリーの欠陥自動代 替を実現する。

【梻成】 半導体記憶菜子で構成されたメモリー4、上 位装置とのインタフェースを制御する回路1および、イ ンタフェースからの要求によりメモリー上のデータ転送 を制御する回路2マイクロプロセッサ3、データ転送エ ラー検出訂正部5、転送エラー情報を記憶する為の不揮 発性メモリー部6、代替用の半導体メモリー部1を有 し、電源投入時にメモリー上の故障箇所をチェックし、 故障が確認された場合には自動的に代替エリアに故障値 所を割り付ける特徴を有し、インタフェースからの要求 によりデータを転送している最中にメモリーの故障が確 認された場合、デーク転送終了後、故障箇所を自動的に 代替エリアに故障箇所を割り付け故障箇所のデータを待 避する特徴を有する半導体ディスク装置。



発用の実施例(プロック図)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 以下の要素を有する半導体ディスク装置 (a) 半導体記憶素子で構成されたメモリー、(b) 他の装置とのインタフェースを制御するインターフェース制御部、(c) 上記メモリーと上記インターフェース制御部との間にあって、インターフェース制御部からの要求によりメモリーへアクセスするデータ転送制御部、

(d) 上記メモリーの故障箇所をチェックし、故障箇所 がある場合には、これを代替する代替手段。

【請求項2】 以下の要素を有する半導体ディスク装置 (a) 半導体記憶素子で構成されたメモリー、(b) 上位装置とのインタフェースを制御するインターフェース 側御部、(c) 上記メモリーと上記インターフェース側 御部との間にあって、インクーフェース制御部からの要求によりメモリーへアクセスするデータ転送制御部、

(d)上記データ転送削御部によるデータの転送により メモリーの故障が確認された場合、これを代替する代替 手段。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【 産業上の利用分野 】この発明は、たとえば、半導体ディスク装置のメモリーの欠陥自動代替方式に関するものである。

[0002]

【従来の技術】図4は従来の半導体ディスク装置の構成 をプロック図に示したものである。図4において、1は インクフェース制御部、2はデータ転送制御部、3はマ イクロプロセッサ、4は半導体メモリー部である。次に 動作について説明する。電源投入後、マイクロプロセッ サ3は動作を開始し、図5に示すフローチャートに示す 様に動作を開始する。マイクロプロセッサ 3 は、データ 転送制御部2をコントロールし任意のデータを半導体メ モリー部4に転送し (ステップ37) 、半導体メモリー 部4に故障箇所の有無を確認する(ステップ38)。故 障箇所が発見された場合には、インタフェース部1より 上位装置に対して故障の発生を報告する。報告を受けた 上位装置はシステム異常として異常終了する(ステップ 39)。通常動作中に半導体メモリー部4に故障が発生 した場合には、インタフェース部1より上位装置に対し て、データエラー発生を報告し、上位装置は異常終了す る。上記の状態で異常終了した場合には故障した半導体 メモリー部4を交換する必要があった。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】従来の半導体ディスク 装置では以上のように構成されている為、半導体メモリ 一上に故障が発生した場合には動作不可能な状態にな り、システムダウン等の低大障害につながる可能性が高 かった。この発明は上記のような問題点を解決する為に なされたもので、電源投入時に発生の確認されたメモリ 一の故障を自動的に代替できるとともに、動作中に発生 したメモリーの故障を自動的に代替することにより高信頼性の半導体ディスク装置を得ることを目的とする。

[0004]

【課題を解決するための手段】この発明に係る半導体ディスク装置は、以下の要素を有するものである。 (a) 半導体記憶素子で構成されたメモリー、 (b) 上位装置 とのインタフェースを制御するインターフェース制御部、 (c) 上記メモリーと上記インターフェース制御部 との間にあって、インターフェース制御部からの要求によりメモリーへアクセスするデータ転送制御部、 (d) 上記メモリーの故障箇所をチェックし、故障箇所がある場合には、これを代替する代替手段。

【0005】また、この発明に係る半導体ディスク装置は、以下の嬮素を有するものである(a)半導体記憶素子で構成されたメモリー、(b)上位装置とのインタフェースを制御するインターフェース制御部、(c)上記メモリーと上記インクーフェース制御部との間にあって、インターフェース制御部からの要求によりメモリーへアクセスするデータ転送制御部、(d)上記データ転送制御部によるデータの転送によりメモリーの故障が確認された場合、これを代替する代替手段。

[0006]

【作用】この発明に係る半導体ディスク装置は、たとえば、電源投入時等に半導体メモリー素子の故障の有無を確認する機能を有し、故障が確認された場合には代替用の半導体メモリーに自動的に割り付け、半導体メモリー素子の故障による半導体メモリー素子の交換を未然に防ぐようにしたものである。

【0007】更に動作中に発生した半導体メモリー案子の故障を、インタフェースからのデーク転送時に確認し、確認された場合には、インタフェースへのデーク転送終了後、自動的に代替用の半導体メモリー素子に割り付け、半導体メモリー素子の故障による半導体メモリー素子の交換を未然に防ぐようにしたものである。

[0008]

【実施例】

実施例1.以下この実施例を図について説明する。図1において、1はインターフェース制御部、2はデータ転送部、3はマイクロプロセッサ、4は半導体メモリー部、5はデータ転送エラー検出訂正部、6は転送エラー情報を記憶する為の不揮発性メモリー部、7は代替用の半導体メモリー部である。太線は、データの流れを示し、細線は制御の流れを示す。

【0009】次に動作について説明する。電源投入後、マイクロプロセッサ3は、図2に示すフローチャートに従い動作を開始する。図2において100は自己診断代替手段、200は動作中代替手段である。電源投入後、自己診断代替手段100は以下のような動作を行う。マイクロプロセッサ3は、データ転送部2に転送命令を出す(ステップ22)。転送命令を受けたデータ転送部2

は、データエラー検出訂正部5を通してデータを転送する(ステップ23)。データ転送時に、データエラー検出訂正部5がエラーを検出した場合、データ転送終に再度データエラーの発生した半導体メモリー部を確認し(ステップ24)、データエラーが確認された場合には半導体メモリー部の論理的ブロックアドレスを物理的アドレスに変換し、図3に示すように不揮発性メモリー部6へ記録する(ステップ25)。半導体メモリー部のででが変換し、不揮発性メモリー部のに記録するにも対象が完了後、不揮発性メモリーののがでクロックを代替用半導体メモリ部のアトレスより、半導体メモリ部のアータエラーのあったプロックを代替アドレスを作成する(ステップ25)。この用に自己診断により代替割付けテーブル61作成後、インタフェース部1をコマンド符ち状態にする。(ステップ27)。

【0010】次に、動作中代替手段200について説明 する。インクフェース部1からデータ転送吸収が発生し た場合(ステップ28)、データ転送範囲内に故障の発 生した論理プロックがあるかどうか不揮発性メモリー部 6の代替割付けテーブル61を参照し、該当ブロックが 存在する場合には代替用半導体メモリー部7よりデータ を転送し、該当ブロックが存在しない場合には半導体メ モリー部4よりデータを転送するようにデータ転送制御 部2に転送命令を出す(ステップ29)。データ転送終 了後、デーク転送中のエラーの発生を確認し(ステップ 31) エラーが発生した場合には、再度エラー発生を確 認する (ステップ32) 。エラーが確認された場合に は、データエラー検出訂正部5でエラーの発生した物理 アドレスを不揮発性メモリー部6に記録する (ステップ 33)。代替用半導体メモリ一部7に不抑発性メモリー 部6に記録した物理的アドレスより、代替エリアに削り 付ける為のテーブルを作成する(ステップ34)。故障 発生したブロックのデータを全て代替用半導体メモリー **節7へ転送する(ステップ35)。転送完了後、インタ** フェース部1をコマンド待ち状態にする。(ステップ2 7)。なお、データ転送時にデータエラーが発生した場 合でもデータ転送エラー検出訂正部5を通ってデータを インターフェース制御部へ送出する為、インタフェース 部1からは修正されたデータが送出され、上位装置はエ ラー発生の有無を検出しない。

【0011】以上のように、この実施例は、半導体記憶 素子で構成されたメモリー、上位装置とのインタフェースを制御する回路および、インタフェースからの要求によりメモリー上のデータ転送を制御する回路を有し、電 源投入時にメモリー上の故障箇所をチェックし、故障が確認された場合には自動的に代替エリアに故障箇所を割り付ける特徴を有する半導体ディスク装置を説明した。【0012】また、半導体記憶索子で構成されたメモリー、上位装置とのインタフェースを側御する回路および、インタフェースからの要求によりメモリー上のデー

タ転送を制御する回路を有し、インタフェースからの要 水によりデークを転送している最中にメモリーの故障が 確認された場合、デーク転送終了後、故障箇所を自動的 に代替エリアに故障箇所を削り付け故障箇所のデータを 待避する特徴を有する半導体ディスク装置を説明した。 【0013】次に、従來の代替トラックを用いた磁気デ ィスク等の代替方式とこの実施例の半導体ディスクにお ける代替方式について比較する。従来の磁気ディスク装 **逆は、デークを記録する媒体が磁気円板である。磁気円** 板上にデータを記録する場合、必ずデータが正常に書き 込めない場所が円板上に存在する。このデータが正常に 書き込めないエリアを代替するのが磁気ディスク装置の 代替である。しかし、半導体ディスク設置の場合、デー 夕を記録する媒体が半導体メモリであり正常に否き込め ないエリアは事実上存在しない。書き込めないエリアが 存在しないので磁気ディスク装置のような代替機能は適 用していないのが一般的である。また、磁気ディスク装 硷の代替動作はメーカーが生産段階で実施するか、上位 装置からのフォーマットコマンドによって行われるもの であり、生産段階などで代替動作を必要とすることは半 導体ディスク装置の場合は有り得ない。

【0014】この実施例は、磁気ディスク装置で実施す るような生産時や出荷時の代替動作は行わず、半導体デ ィスク裝置の電源投入時に毎回半導体ディスク裝置の半 導体メモリ部をチェックすることにより故障が発生した 場合には、装置内部で自動的に判断して、装置の代替領 域に代替動作を実行する。(磁気ディスク装置では起動 時に磁気ディスク装置全体の欠陥チェックを実施して自 励的に内部で代替するような機能を有していない) 点に 特徴がある。また、半導体ディスク装置動作時に、リー ド時のデータ転送で故障を検出して、転送終了後に装置 内部で判断し、欠陥発生を認識した場合には自動的に装 **囮の代替領域に代替動作を実行する(代替するデータは** 自動的に修正して代替領域に転送する)ことを特徴とし ている。磁気ディスク装置でもインタフェースからの応 答時に欠陥が確認された場合には代替助作を実行する構 成のものもあるが、インタフェースを介した上位装置か らのからの代替動作に関する設定が必要である。代替動 作を実行した場合でも代替エリアに転送したデータが正 常な内容を保持している保証はない。

【0015】以上のように、この実施例によれば、半導体メモリの故障発生の有無を電源投入時に確認し、自動的に代替動作を実行する為、半導体ディスク装置の故障を未然に防ぐことができる。また、インタフェースからのリード中に半導体メモリの故障を検出した場合(リードエラー検出回路により判断される)インタフェースには修正したデークを送出し、上位装置には故障を意識させず、転送終了後、該当するエラー発生箇所を内部的にチニックし故障が確認された場合には代替メモリ領域に自動的に修正したデークを移動することができる(代替

助作の設定をインタフェースを介して上位装置から行う 必要はない)。また、従来の半導体ディスク装置では電 **源投入後に記憶領域全面の欠陥チェックは実行していな** い。その為、メモリ部の故障により欠陥が発生した場 合、起動後インタフェースから欠陥の発生したブロック をアクセスするまで装置の異常に気づかず、アクセスし た場合には欠陥を回避する手段を持たない。(半導体デ ィスク装置を接続するシステム全体の故障につなが る。) この実施例では、起動時に欠陥を自動的に代替す る為、半導体メモリ部の故障による半導体ディスク装置 を接続するシステム全体の故障を回避することができ る。また、前述したように、磁気ディスク装置では電源 投入後に記憶領域全面の欠陥チェックは実行していない 為、上記従来の半導体ディスク装置と同様にインタフェ ースから該当する欠陥ブロックをアクセスするまで代替 動作を実行しない。磁気ディスク装置の場合、欠陥は磁 気円板上の物理的なキズにより発生することが多く、欠 陥が発生した場合には早急に代替動作を実行しない場 合、欠陥が増大し、代替助作を実行しても該当プロック のデータを正常に代替エリアに移動させることが出来な くなる可能性が高い。また、磁気ディスク装置では動作 中に発生した欠陥に関しては通常動作中に代替する機能 を有しているがこの動作を実行させるためにはインクフ ェースを介した上位装置からの設定が必要である。しか し、この実施例ではインクフェースを介した上位装置か らの設定によらず故障は自動的に代替する。

【0016】実施例2. なお、上記実施例では、半導体メモリー部4と代替用半導体メモリー部7を分割した例を示したが同一メモリー部内を分割して使用しても同等の効果が得られる。

【0017】 実施例3. また、上記実施例では、不揮発性メモリー部6を半導体メモリー部4と代替用半導体メモリー部7から分割した例を示したが、同一メモリー部内を分割して使用しても同等の効果が得られる。ただし、不揮発性メモリー部6として用いられる部分はバッテリーバックアップすることにより、あるいは、フラッシュメモリー等を用いることにより不揮発性である必要

がある。

LATER OF THE PROPERTY.

【0018】実施例4、また、上記実施例では、自己診断を電源投入後に毎回行う場合を示したが、電源投入後に行うのではなく、コマンドを入力して任意の時点で実行させるようにしてもよい。またタイマ機能をもたせて、自己診断をたとえば24時間ごとに実行させるようにしてもよい。

【0019】 実施例 5. また、上記実施例では、電源投入時の代替と動作中の代替の両方有している場合を示したが、いずれか一方を有している場合でもよい。

[0020]

【発明の効果】以上のようにこの発明によれば、半導体メモリー部に故障が発生した場合に自動的に代替用半導体メモリー部に削り付けるように構成したので、使用時に半導体メモリー部が故障した場合でも、すぐに装置の故障に結びつくことはなく、高信頼性の半導体ディスク装置を提供することができる。

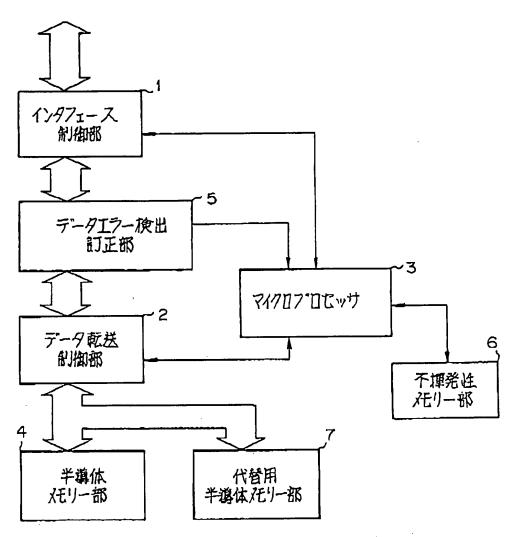
【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明のブロック図。
- 【図2】本発明の動作のフローチャート図。
- 【図3】本発明の不揮発性メモリー部の代替割付けテー ブルの一例を示す図。
- 【図4】従来のブロック図。
- 【図5】従来の動作のフローチャート図である。

【符号の説明】

- 1 インタフェース制御部
- 2 データ転送部
- 3 マイクロプロセッサ
- 4 半導体メモリー部
- 5 データ転送エラー検出訂正部
- 6 転送エラー情報を記憶する為の不揮発性メモリー部
- 7 代替用の半導体メモリー部
- 8 インタフェース制御部
- 9 データ転送制御部
- 10 マイクロプロセッサ
- 11 半導体メモリー部

[図1]

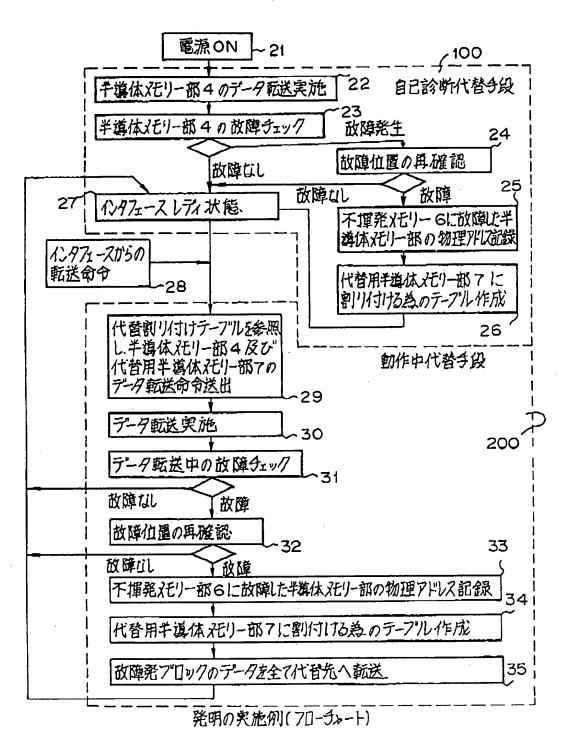


発明の実施例(プロック図)

[図3]

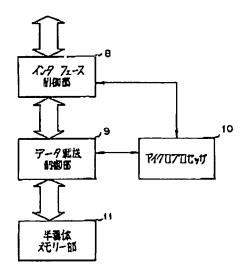
, 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[図2]



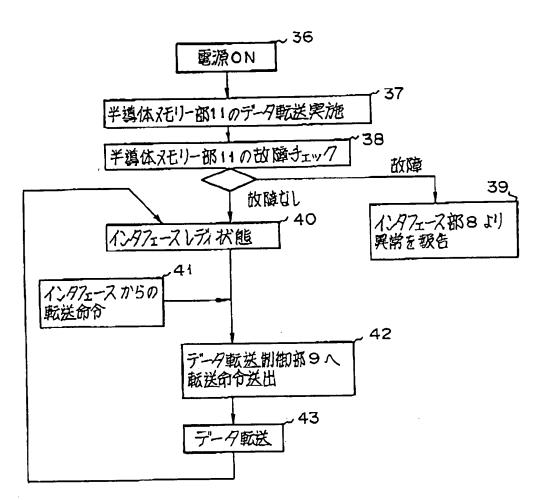
(7)

[図4]



従来の実施例(プロvク図)

[図5]



従来の奥施例(70-チャート)